

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成30年4月19日(2018.4.19)

【公表番号】特表2017-507342(P2017-507342A)

【公表日】平成29年3月16日(2017.3.16)

【年通号数】公開・登録公報2017-011

【出願番号】特願2016-573713(P2016-573713)

【国際特許分類】

G 0 1 N 27/447 (2006.01)

G 0 1 N 21/64 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 27/447 3 2 5 B

G 0 1 N 27/447 3 1 5 K

G 0 1 N 21/64 F

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月5日(2018.3.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キャピラリー電気泳動アッセイを行うためのシステムであって、

電磁放射の源ビームを提供するように構成される、光源と、

1 つ以上の標的分子または分子配列を含む複数のキャピラリーを受容するように構成される、インターフェースと、

使用時に前記源ビームから複数の出力ビームを生成し、前記出力ビームのそれぞれを、前記複数のキャピラリーのうちの対応するキャピラリーに誘導するように構成される、照明光学システムと、を備える、システム。

【請求項 2】

キャピラリー電気泳動アッセイを行うためのシステムであって、

電磁放射の複数の出力ビームを提供するように構成される、光源と、

アレイ検出器を備える、分光計と、

1 つ以上の標的分子または分子配列を含むキャピラリーのアレイを受容するように構成される、インターフェースと、

使用時に前記複数の出力ビームのそれぞれを、前記複数のキャピラリーのうちの対応するキャピラリーに誘導するように構成される、照明光学システムと、

前記検出器において同時に複数のスペクトルを生成するように構成され、各スペクトルが、前記キャピラリーアレイのそれぞれのアレイに対応する、発光光学システムと、を備える、システム。

【請求項 3】

前記複数のキャピラリーをさらに備える、請求項 1 または 2 に記載のシステム。

【請求項 4】

キャピラリー電気泳動アッセイを行うためのシステムであって、

電磁放射の複数の出力ビームを提供するように構成される、光源と、

1 つ以上の標的分子または分子配列を含む複数のキャピラリーを受容するように構成される、インターフェースと、

使用時に前記複数の出力ビームのそれぞれを、前記複数のキャピラリーのうちの対応するキャピラリーに誘導するように構成される、照明光学システムと、

それぞれが前記キャピラリーのうちの対応するものと関連付けられている複数のファイバを備える分光計と、を備える、システム。

【請求項 5】

前記照明光学システムが、前記複数の出力ビームを生成するように構成されるビーム分割器を備える、請求項 1、2、3、または 4 に記載のシステム。

【請求項 6】

前記照明光学システムが、前記複数の出力ビームを生成するように構成される回折光学素子を備える、請求項 1、2、3、または 4 に記載のシステム。

【請求項 7】

前記照明光学システムが、前記複数の出力ビームを生成するように構成されるホログラフィック光学素子を備える、請求項 1、2、3、または 4 に記載のシステム。

【請求項 8】

前記複数の出力ビームが、4 つのビームを含む、請求項 1、2、3、または 4 に記載のシステム。

【請求項 9】

前記複数の出力ビームの前記それぞれが、楕円形断面を特徴とする、請求項 1、2、3、または 4 に記載のシステム。

【請求項 10】

前記複数の出力ビームの前記それぞれが、その他の出力ビームと平行である、請求項 1、2、3、または 4 に記載のシステム。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

本明細書に使用されるとき、「放射源」という用語は、電磁放射の源、例えば、電磁スペクトルの可視、近赤外、赤外、及び/または紫外波長帯のうちの 1 つ以上内にある電磁放射の源を指す。本明細書に使用されるとき、「光源」という用語は、電磁スペクトルの可視帯内のピークまたは最大出力（例えば、力、エネルギー、または強度）を含むスペクトルから構成される電磁放射の源を指す。

本発明は、例えば、以下を提供する。

(項目 1)

キャピラリー電気泳動アッセイを行うためのシステムであって、

電磁放射の源ビームを提供するように構成される、光源と、

1 つ以上の標的分子または分子配列を含む複数のキャピラリーを受容するように構成される、インターフェースと、

使用時に前記源ビームから複数の出力ビームを生成し、前記出力ビームのそれぞれを、前記複数のキャピラリーのうちの対応するキャピラリーに誘導するように構成される、照明光学システムと、を備える、システム。

(項目 2)

キャピラリー電気泳動アッセイを行うためのシステムであって、

電磁放射の複数の出力ビームを提供するように構成される、光源と、

アレイ検出器を備える、分光計と、

1 つ以上の標的分子または分子配列を含むキャピラリーのアレイを受容するように構成される、インターフェースと、

使用時に前記複数の出力ビームのそれぞれを、前記複数のキャピラリーのうちの対応

するキャピラリーに誘導するように構成される、照明光学システムと、

前記検出器において同時に複数のスペクトルを生成するように構成され、各スペクトルが、前記キャピラリーアレイのそれぞれのアレイに対応する、発光光学システムと、を備える、システム。

(項目3)

前記複数のキャピラリーをさらに備える、項目1または2に記載のシステム。

(項目4)

前記照明光学システムが、前記複数の出力ビームを生成するように構成されるビーム分割器を備える、項目1、2、3、または10に記載のシステム。

(項目5)

前記照明光学システムが、前記複数の出力ビームを生成するように構成される回折光学素子を備える、項目1、2、3、または10に記載のシステム。

(項目6)

前記照明光学システムが、前記複数の出力ビームを生成するように構成されるホログラフィック光学素子を備える、項目1、2、3、または10に記載のシステム。

(項目7)

前記複数の出力ビームが、4つのビームを含む、項目1、2、3、または10に記載のシステム。

(項目8)

前記複数の出力ビームの前記それぞれが、楕円形断面を特徴とする、項目1、2、3、または10に記載のシステム。

(項目9)

前記複数の出力ビームの前記それぞれが、その他の出力ビームと平行である、項目1、2、3、または10に記載のシステム。

(項目10)

キャピラリー電気泳動アッセイを行うためのシステムであって、

電磁放射の複数の出力ビームを提供するように構成される、光源と、

1つ以上の標的分子または分子配列を含む複数のキャピラリーを受容するように構成される、インターフェースと、

使用時に前記複数の出力ビームのそれぞれを、前記複数のキャピラリーのうちの対応するキャピラリーに誘導するように構成される、照明光学システムと、

それぞれが前記キャピラリーのうちの対応するものと関連付けられている複数のファイバを備える分光計と、を備える、システム。